1D11

## 低分子ゲル化剤の自己組織化を利用した 基板上へのナノファイバの作製と機能化

 ○ 綱島 亮<sup>1</sup>、野呂 真一郎<sup>1, 2</sup>、 芥川 智行<sup>1, 2, 3</sup>、中村 貴義<sup>1, 2, 3</sup>、 吉冨太一<sup>4</sup>、川上 宏子<sup>4</sup>、戸澗 一孔<sup>4</sup>
(北大院地球環境<sup>1</sup>・北大電子研<sup>2</sup>・CREST-JST<sup>3</sup>・野口研<sup>4</sup>)

低分子ゲルにおいては、ゲル形成物質が選択的、かつ自己 組織化的にファイバ状の形状をとり、3 次元網目構造を形成 する。このファイバ状のモルホロジーを Langmuir-Blodgett (LB) 法を利用して基板上へ移行しナノワイヤを構築するこ とを検討した。

Figure 1 に用いたゲル化剤 1-3 の表面圧(π) -分子占有面積 (A)等温線を示した。ゲル形成物質 1 は 40 mN/m 付近まで安 定な水面上単分子膜を形成した。Figure 2 に表面圧 20, 25, 35, 45 mN/m で固体基板上に移行した LB 膜の AFM 像を示した。 低圧時では、楕円状の分子集合体を形成し、35 mN/m 以上で はナノファイバを構築することが明らかとなった。得られた ナノファイバ (35 mN/m) は高さが 1.2 nm 程度、長さが数マ イクロメートルであり、用いたマイカ基板表面の結晶構造を 反映して 60°または 120°に配向していた。得られた単分子膜 を横振動摩擦力顕微鏡を用いて表面摩擦力測定を行った結 果、ファイバの表面には親水基が配向し、分子が規則的に配 列した結晶性の高い分子集合体を形成していることが示唆 された。



**Figure 1. 1, 1:2**=80:20, **2** and **3** のπ-A曲線



Figure 2. (a) 20、(b) 25、(c) 35、(d) 45 mN/m の表面圧で移行した膜の AFM 像と高さプロファイル

そこで、これらの特徴を持つナノファイバに電子活性を付与する事を 試みた。1の表面配向基であるアルコール基を金微粒子の吸着能を有す る-NH<sub>3</sub><sup>+</sup>基に換えた分子 2 は静電力により表面が負に帯電した金微粒子 と相互作用する事が可能である。ファイバの表面配向基が親水基であっ たことから、2 を用いる事によりファイバの表面配合微粒子の吸着サイ トが配向すると期待できる。LB 膜を作製したところ、分子 2 は均一な 二次元膜を与えたが (Figure 3a)、1:2=80:20の混合単分子膜をマイ カ基板上に表面圧 35 mN/m で移行した場合、1 単独の場合と同様にナ ノファイバの形成が確認できた(Figure 3b)。この膜に金コロイド溶液を キャストしたところ、Figure 4 に示した SEM 像に見られる金微粒子列 を得る事ができた。得られた金微粒子列は、鋳型としたファイバと同様 に 60 度または 120 度に配向していた、金コロイド溶液をキャストする 前後に渡って同一箇所で AFM 測定を行った結果、ファイバのパターン を維持したまま金微粒子を配列できる事が判明した。

次に、フラーレンを結合した分子 3 を新たに合成し電子活性の付与 を検討した。Figure 5 に表面圧 5,25 mN/m で移行した分子 3 の LB 膜の AFM 像を示した。表面圧 5 mN/m では、分子 3 は基板上でファイバ状 の分子集合体が密に詰まった膜を形成した。AFM から見積もられた高 さが 0.8 nm 程度であった事から、分子は基板平面に水平に配向してい Figure 3. 35mN/m で 移行した(a)2, (b)1:2 = 80:20 の LB 膜の AFM 像。

ると示唆された。25 mN/m で移行した場合、高さが 4.0 nm の島状のドメイン構造を形成した。多 層膜の XRD、IR 測定から、分子は基板法線に対して傾き、面間隔が 3.98 nm の二層構造からなる 多層膜を形成している事が明らかになった。



Figure 4.1:2=80:20 混合 LB 膜に金微粒子を吸着させた膜 の SEM 像

**Figure 5**. (a) 5 mN/m、(b) 25 mN/m で移行した **3** LB 膜の AFM 像

